



## 「若手の会」，「第2回光学薄膜研究会 総会・研究会」開催のご案内

研究会主催「若手の会」，「2017年度第2回 光学薄膜研究会」を下記の通り開催致します。皆様のご参加をお待ちしております。開催場所にご注意ください。今回は真空展会場内での同時開催となります。「小倉名誉教授セミナー」は今回お休みです。

◆日時：2017年9月6日（水）

◆場所：パシフィコ横浜（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）

<http://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx>

※開催場所が従来と異なりますのでご注意ください。

### 1. 若手の会（10:00～12:00）

・受付：9:30～10:00

・題目：若手の会 各グループ別ミーティング

※当日の開催は各グループ別にリーダーの判断となりますので、  
新規参加申込者には別途ご連絡いたします。

・部屋：パシフィコ横浜 会議室

・参加資格：学生、光学薄膜研究会会員（45歳まで）

・参加費用：無料（事務局への参加申込が必要です）

・その他：別紙のご案内もご覧下さい。

※新規ご参加希望の方は事務局までご連絡ください。

### 2. 第2回研究会（10:00～16:30）※真空展と同時開催です。

・受付：9:00～10:00

・部屋：パシフィコ横浜 アネックスホール

・研究会：10:00～16:30（今回はAM10:00～です）

・定員：約150名（会員）

・参加費：会員、非会員ともに無料

（真空展に参加される非会員の方も無料参加可能です）

会員の方のために会場前側の席をご用意しています。

### 3. 懇親会（17:15～19:15）今回は会員のみに限らせていただきます。

・受付：総会&研究会受付時に同時にお申込下さい。

懇親会のみ参加者は懇親会開始前に受け付け致します。

・参加費：3,000円/人

・場所：リストランテ アッティモ（パシフィコ横浜内）

<http://www.pacifico.co.jp/visitor/floorguide/exhibition/tabid/205/Default.aspx#floor2>

---

## 【研究会プログラム】

### (1) 「クリーン度の管理とパーティクルカウンタの限界と有効性」 (10:00-10:45)

水野 真人様 (㈱エアリーテクノロジー 代表取締役)

HEPA、クリーンルーム、パーティクルカウンタ (OPC) は使われ続けて半世紀、ISO も整い清浄度管理は進歩した。しかし、OPC が一般化したことによる弊害も垣間見える。測定器の今後の有効活用について検討する。

### (2) 「比較的小さなガラス基板におけるコート前洗浄の方法と問題点」 (10:45-11:30)

浜 公洋 様 (元ソニックフェロー(株))

洗浄の基本として、汚れ除去から乾燥までの方法について概略説明します。また比較的小さなコート前ガラス基板について、板ガラスを研磨やカット加工する場合、加工しない受け入れ洗浄など、落としたい汚れをどのように落とし、乾燥までどのように表面を仕上げるか、量産装置として実際の洗浄方法及び問題点を解説します。

### (3) 「光学材料特性評価における紫外可視分光光度計の分析テクニック」 (11:30-12:15)

大西 晃宏様 (メイショーテクノ 代表取締役)

近年、光学材料の光学的特性はより低い値、より精度の高い値の評価が要求されています。高性能・高精度の特性値を得るためには分光光度計の性能を引き出すための知識や技術が必要です。それらの分析テクニックについて紹介します。

### (4) 「ダイヤモンドライクカーボン膜, その作り方と光学特性他諸特性」 (13:00-13:45)

滝川 浩史 教授 (豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系教授)

ダイヤモンドライクカーボン (DLC) 膜は、多様な分野において利用が拡大しつつある。同膜は多様な方法で作製され、特性もそれぞれ異なる。本講では、DLC 膜の主要な製造方法、種々の特性、分類、応用例を紹介し、光学定数に基づいた規格化について意見を述べる。

### (5) 「ナノ構造体微細成形技術による表面機能制御デバイスの開発」 (13:45-14:30)

栗原 一真 様 (産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター)

本講演では、ナノ構造体の加工技術や微細成形技術を用いて、ナノ凹凸表面を用いた反射防止機能付撮像系レンズや、表面凹凸を用いて成形品表面の濡れ性制御を変化させ、成形だけで毛細管を発現できるピペットなど、さまざまな機能化表面デバイスの開発を行っているので、開発例について紹介する。

### (6) 「ナノ形状の超精密測定について」 (14:45-15:30)

本田 裕 様 ((株)小坂研究所 技術部 開発企画チーム 主任)

表面粗さ測定機の老舗メーカーである当社が、薄膜等の微細な表面形状・粗さ・

膜厚を高精度に測定するための計測技術と、目的に見合った接触・非接触検出器の特性を解説します。

(7) 「偏光解析法による蒸着膜の評価と in-situ モニターリング」 (15:30:16:15)

川畑 州一 教授 (東京工芸大学 名誉教授)

偏光解析法は薄膜や界面の評価および研究において大変有力な手法であるが、成膜などの現場ではあまり活用されていないのが現状です。本講演では蒸着膜のモニターとしての偏光解析法の特色とメリットについて解説します。

(8) 事務局からのご案内 (16:15-16:30)

\*注：プログラムは、諸般の事情により変更する場合がございます。

---

5. 参加申込：光学薄膜研究会 事務局 鬼崎 ( [info-otfse@otfse.org](mailto:info-otfse@otfse.org) ) 宛

メールにて

- ① 若手の会参加の有無 (メンバーと新規希望者のみ) :
- ② 研究会参加の有無 :
- ③ 懇親会参加の有無 :
- ④ 氏名, 所属 :
- ⑤ 住所
- ⑥ 電話番号、FAX番号
- ⑦ メールアドレス :

をご連絡ください。申し込み締め切り8月30日(水)です。

**【重要連絡事項】**

- ・上記情報は、真空展事務局へも連絡されます。
- ・不記載項目がありますと受付できません。  
代表者が申し込まれます場合も、全員分のデータをお願いします。
- ・出席登録者は、研究会受付にて会員として名刺と交換で「真空展」  
入場証をお受取りください。
- ・非登録者は非会員参加者としての扱いになりますので、定員を  
超えますと入場できなくなる場合がございます。

以下、ご注意とお願いです。

・講演資料は、8月30日頃にHP 会員ページに掲載予定ですので、事前にプリントアウトの上ご持参ください。当日の印刷物配布は原則致しません。  
(会員以外の方で当日参加されます方は、当日に白黒印刷で講演資料をお渡しします。)

### パシフィコ横浜へのアクセス

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1

<http://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx>



以上